Beschreibung

Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstrukten

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstrukten gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

10 Bei der Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktierungen realisiert sind, existiert das Problem, dass eine auf das Leiterbahnenbild aufgebrachte Isolierlack-Schicht insbesondere an den Öffnungskanten der Durchgangsbohrungen der Durchkontaktierungen keine sichere Isolierung gewährleistet.

Der Grund hierfür ist zum einen, dass der Isolierlack in die Durchgangsbohrungen läuft und sich an den Öffnungskanten der Durchgangsbohrungen quasi abstreift. Hierdurch wird die Dicke der Isolierlack-Schicht an den betreffenden Kanten zumindest sehr dünn. Zum anderen ist die Isolierlack-Schicht nicht zu 100% porendicht, so dass es kleine und kleinste Löcher gibt, die den elektrischen Widerstand in bezug auf die darunter angeordnete elektrisch leitende Schicht, die in diesem Fall die elektrische Durchkontaktierung bildet, kleiner als Unendlich werden lassen.

Dies wirkt sich zum Beispiel dann nachteilig aus, wenn oberhalb der Durchkontaktierung eine weitere elektrisch leitende Schicht, sei es in Form zum Beispiel einer weiteren Leiterbahn oder in Form zum Beispiel einer größeren Fläche, angeordnet wird. Der Vorteil, der hier erzielt wird, ist, dass die Oberfläche der Leiterplatte oder eines entsprechenden Konstrukts wesentlich intensiver genutzt wird. Es werden nämlich auch diejenigen Bereiche verwendet, die ansonsten frei gelassen werden, um Kurzschlüsse zu den Durchkontaktierungen sicher zu verhindern.

Bei den Kurzschlüssen muss es sich dabei nicht zwangsläufig jeweils um extrem niederohmige Kurzschlüsse handeln. Kurzschlüsse sind auch dann vorhanden, wenn der Isolationswiderstand kleiner Unendlich wird, so dass die Möglichkeit besteht, dass Kriechströme fließen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein einfaches und kostengünstiges Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktierungen realisiert sind, zumindest in deren Nähe weiter Leiterbahnen oder Ähnliches vorgesehen sind, anzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren gelöst, das die im Anspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte aufweist.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es einfach in der Ab20 wicklung ist und dass trotzdem sichergestellt ist, dass keine
Kurzschlüsse zwischen den Durchkontaktierungen und den zumindest in der Nähe der Durchkontaktierungen angeordneten Leiterbahnen oder dementsprechend Ähnlichen fabriziert sind.

Das Verfahren ist einfach in der Abwicklung und es ist kostengünstig, weil insbesondere ein sehr aufwendiger BürstVerfahrensschritt, in dem die Oberfläche der Leiterplatte oder eines entsprechenden Konstrukts gebürstet wird, eingespart wird. Das Verfahren ist auch deshalb einfach und kostengünstig, weil durchwegs Standardmittel verwendbar sind und es somit nicht notwendig ist, Spezialmittel zumindest bei manchen Verfahrensschritten zu verwenden. Das Verfahren gewährleistet die Kurzschlusssicherheit insbesondere auch oberhalb der Durchkontaktierungen, weil oberhalb der Durchkontaktierungen praktisch drei Isolierschichten aufgebracht sind. Erstens ist damit eine insgesamt relativ dicke Gesamtisolierschicht realisiert und ist zweitens die Wahrscheinlichkeit,

- ;

dass bei drei Isolierschichten dreimal eine offene Pore der jeweiligen Isolierschicht jeweils genau aufeinander trifft, praktisch ausgeschlossen.

5 Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen.

10

35

Danach können identische Standardmittel in mehreren Verfahrensschritten eingesetzt werden, in denen vormals wenigstens zum Teil Spezialmittel erforderlich waren.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Standartmittel kostengünstige Mittel sein können.

15 Ein weiterer Vorteil ist, dass die oberhalb der Durchkontaktierungen angeordneten Leiterbahnen oder dergleichen mit kostengünstigem Karbon realisiert sein können.

Schließlich ist es vorteilhaft, dass die Vereinzelung der 20 Leiterplatten oder der entsprechenden Konstrukten nach wie vor durch einfaches Fräsen aus einem größeren Gebilde heraus erfolgen kann.

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand 25 einer Zeichnung näher erläutert.

In der einzigen Figur sind auf der linken Seite die Abläufe eines bisherigen Verfahrens und auf der rechten Seite die Abläufe des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktierungen im Größenbereich von 20 µm realisiert sind, in deren Nähe bzw. oberhalb derer weitere Leiterbahnen oder Entsprechendes angeordnet sind, einander gegenübergestellt.

Das bisherige Verfahren weist am Beispiel der Herstellung einer Leiterplatte folgende Verfahrensschritte auf:

 Bohren der Durchgangsbohrungen für die Durchkontaktierungen;

- 2. Herstellen der Durchkontaktierungen;
- 5 3. Füllen der Bohrungen der Durchkontaktierungen mit einer ätzbeständigen Plugging-Paste (= ein Spezialmittel);
 - Bürsten der Oberflächen, damit es möglich wird, nachfolgend auf planen und sauberen Flächen das Ätzbild (Leiterbahnenbild) zu erzeugen;
- 5. Ätzen der Leiterplatte, worunter alle Maßnahmen zu verstehen sind, die notwendig sind, dass ein fertiges Leiterbahnenbild erzeugt ist;
 - 6. Lackieren der Oberflächen mit einem Stopplack, so dass eine erste Lackschicht aufgebracht ist, die wenigstens
- geringfügig die elektrisch leitenden Flächen und Flächenteile (Leiterbahnen) bedeckt und auch die Oberflächen der Durchkontaktierungen und weiter die Zwischenräume zwischen den elektrisch leitenden Flächenteilen wenigstens zum Teil verfüllt;
- 20 7. Aufbringen des eigentlichen Isolierlacks (ISO-Lack), so dass insgesamt erstens wieder eine plane Oberfläche gegeben ist und zweitens eine sichere Isolierung in bezug auf die darunter angeordneten elektrisch leitenden Flächen und Flächenteile besteht, weshalb es dann möglich ist,
- dass auf diesen Oberflächen weitere elektrisch leitende Flächen und Flächenteile vorsehbar sind mit Ausnahme oberhalb der Durchkontaktierungen, weil dort letztlich durch das Fehlen einer Verfüllung der Durchkontaktierungen doch keine plane Oberfläche entsteht. Hier läuft jedesmal der Lack zumindest etwas in die Durchkontaktierungen
- desmal der Lack zumindest etwas in die Durchkontaktierung hinein;
 - 8. Aufbringen von weiteren elektrisch leitenden Flächen und Flächenteilen (zum Beispiel Karbon-Leiterbahnen (1)), wobei aus Gründen der Vermeidung von Kürzschlüssen insbesondere an den Randkanten (2) der Durchgangsbohrungen der
- sondere an den Randkanten (2) der Durchgangsbohrungen de Durchkontaktierungen, an denen sich nur eine besonders

dünne Isolierung ausbildet, ein relativ großer Abstand eingehalten wird;

- 9. Prüfen der Leiterplatte, und
- 10. Vereinzeln der Leiterplatte durch Herausfräsen der Leiterplatte aus einem Verbund von Leiterplatten, in dem eine Leiterplatte aus Gründen der Wirtschaftlichkeit in der Regel hergestellt wird.

Demgegenüber weist das erfindungsgemäße Verfahren am Beispiel 10 der Herstellung einer Leiterplatte folgende Verfahrensschritte auf:

- Bohren der Durchgangsbohrungen für die Durchkontaktierungen;
- 15 2. Herstellen der Durchkontaktierungen;
 - 3. Ätzen der Leiterplatte, worunter alle Maßnahmen zu verstehen sind, die notwendig sind, dass ein fertiges Leiterbahnenbild erzeugt ist;
- 4. Füllen der Bohrungen der Durchkontaktierungen mit einer

 Standard-Plugging-Paste (= Standardmittel in Form einer einen Einspareffekt erzielenden und den Verfahrensablauf vereinfachenden kostengünstigen Lackvariante), wobei an dieser Stelle auf ein aufwendiges und teures Bürsten der Oberflächen verzichtet werden kann (dies ergibt zusammen
- mit dem Weglassen des aufwendigen und teuren Bürstens der Oberflächen vor dem Ätzen, wie das beim vormaligen Verfahrensablauf ansonsten notwendig war, einen weiteren wesentlichen Einsparungseffekt und eine weitere Vereinfachung des Verfahrensablaufs);
- 30 5. Lackieren der Oberflächen mit einem Stopplack, so dass eine erste Lackschicht aufgebracht ist, die wenigstens geringfügig die elektrisch leitenden Flächen und Flächenteile (Leiterbahnen) bedeckt und auch die Zwischenräume zwischen den elektrisch leitenden Flächenteilen wenigstens zum Teil verfüllt;
 - 6. Aufbringen des eigentlichen Isolierlacks (ISO-Lack), so dass insgesamt erstens wieder eine plane Oberfläche gege-

ben ist und zweitens eine sichere Isolierung in bezug auf die darunter angeordneten elektrisch leitenden Flächen und Flächenteile besteht, weshalb es dann möglich ist, dass auf diesen Oberflächen weitere elektrisch leitende Flächen und Flächenteile vorsehbar sind, und zwar auch direkt oberhalb der Durchkontaktierungen;

- 7. Aufbringen von weiteren elektrisch leitenden Flächen und Flächenteilen (zum Beispiel Karbon-Leiterbahnen (3)), wobei diese elektrisch leitenden Flächen und Flächenteile jetzt auch mindestens bis zu den Durchkontaktierungen und sogar direkt darüber hinweg geführt sein können;
- 8. Prüfen der Leiterplatte, und
- 9. Vereinzeln der Leiterplatte durch Herausfräsen der Leiterplatte aus einem Verbund von Leiterplatten, in dem eine Leiterplatte aus Gründen der Wirtschaftlichkeit in der Regel hergestellt wird.

Die Standard-Plugging-Paste, der Stopplack und der Isolierlack können jeweils identisch sein, das heißt aus eben einer 20 einzigen kostengünstigen Lackvariante bestehen.

Das Aufbringen der Lackschichten kann mittels des an sich bekannten und einfach zu realisierenden Siebdruckverfahrens bewerkstelligt werden.

5

10

15

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktierungen im Größenbereich von 20µm realisiert sind, zumindest
in deren Nähe weiter Leiterbahnen oder eine elektrisch leitende Schicht vorgesehen sind, gekennzeichnet durch
folgende wesentlichen Verfahrensschritte:

- Bohren von im Größenbereich von 20 µm liegenden Durchgangs bohrungen für die nachfolgende Herstellung der Durchkontak tierungen;
 - Durchkontaktieren, indem eine elektrisch leitende Gesamtschicht aufgebaut wird;
- Ätzen des Leiterbahnenbildes in die elektrisch leitende Gesamtschicht;
 - Bohrungen der Durchgänge füllen mit einem Standardmittel;
 - Lackieren der Oberflächen, auf denen Durchkontaktierungen vorhanden sind, zumindest in deren Nähe später Leiterbahnen vorgesehen sind;
- 20 Isolierlack (ISO-Lack), welcher ein Standardmittel ist, aufbringen auf die Oberflächen der Leiterplatte und/oder des entsprechenden Konstrukts;
 - Herstellen von oberhalb der Durchkontaktierungen angeordneten Leiterbahnen;
- 25 Prüfen der Leiterplatte bzw. des entsprechenden Konstrukts;
 - Vereinzeln der Leiterplatte bzw. des entsprechenden Konstrukts.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich net, dass die Standardmittel in den verschiedenen Verfahrensschritten jeweils identisch sind;
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Standardmittel in den verschiedenen
 Verfahrensschritten jeweils kostengünstige Lackvarianten sind.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die oberhalb der Durch-kontaktierungen angeordneten Leiterbahnen mit Karbon (3) realisiert sind.

5

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Vereinzeln der Leiterplatten bzw. der entsprechenden Konstrukte durch einen Fräsvorgang bewerkstelligt ist.

10

1/1

<u>Alt</u> <u>Neu</u> *Bohren *Bohren *Durchkontaktieren *Durchkontaktieren *Bohrungen füllen (mit Spezialmittel) *Bürsten *Ätzen..... *Bohrungen füllen (mit Standardmittel)... *Lackieren..... *Lackieren. *ISO-Lack..... *ISO-Lack. *Karbon *Karbon.... *Prüfen *Prüfen *Fräsen *Fräsen

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interest nai Application No PCT/EP2005/050919

A CLASS	FICATION OF SUBJECT MATTER			
ÎPC 7	H05K1/00 H05K1/11 H05K3/4	0 H05K3/42		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	cation and IPC		
B. FIELDS	SEARCHED		-	
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classificat H05K	ion symbols)		
	tion searched other than minimum documentation to the extent that ϵ			
Electronic d	ala base consulted during the international search (name of data ba	use and, where practical, search terms used	d)	
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	lound annual		
Category	Chauch of document, with includation, where appropriate, of the re-	evant passages	Relevant to claim No.	
Α	WO 02/078411 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; BUSCH, GEORG 3 October 2002 (2002-10-03) page 2, line 9 - page 3, line 5)	1-4	
	page 4, line 12 - page 5, line 29	5; figures		
A	US 5 758 413 A (CHONG ET AL) 2 June 1998 (1998-06-02) column 4, lines 3-54; figures 2-1	10 - ·		
A	US 5 001 605 A (SAVAGIAN ET AL) 19 March 1991 (1991-03-19) column 3, line 51 - column 4, lin figures 2,4	ne 10;	1	
A	US 5 487 218 A (BHATT ET AL) 30 January 1996 (1996-01-30) column 3, lines 2-29; figure 1	·	1	
Furt	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Palent family members are listed i	n annex.	
Special ca	legories of cited documents:	TT Inter degreement multiple 2 - 5 - 5		
consid	ent defining the general state of the art which is not bered to be of particular relevance document but published on or after the international	"T" later document published after the Inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but early underlying the	
filing d	ate nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	*X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do	be considered to current is taken alone	
clation or other special reason (as specified) O'document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means other means Cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document is combined with one or more other such document is combined being obvious to a person skilled				
P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed in the art. *&* document member of the same patent family				
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the International sear	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2	8 July 2005	05/08/2005		
Name and n	naling address of the ISA	Authorized officer	**··	
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk				
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Molenaar, E		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

commation on patent family members

Internal Application No PCT/EP2005/050919

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 02078411	Α	03-10-2002	CN WO EP	1498519 A 02078411 A1 1371275 A1	19-05-2004 03-10-2002 17-12-2003
U\$ 5758413	A -	02-06-1998	US JP JP	5699613 A 3382096 B2 9116267 A	23-12-1997 04-03-2003 02-05-1997
US 5001605	A .	19-03-1991	DK ES IL JP JP	601289 A 2019743 A6 92272 A 2199897 A 7007867 B	31-05-1990 01-07-1991 12-04-1994 08-08-1990 30-01-1995
US 5487218	A	_ 30-01-1996	EP KR US US	0713359 A1 273933 B1 RE37840 E1 5557844 A	22-05-1996 15-12-2000 17-09-2002 24-09-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interpretates Aktenzeichen
PCT/EP2005/050919

A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H05K1/00 H05K1/11 H05K3/40	0 H05K3/42			
Nach der Int	ernationalen Patentkiassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation and der IPK			
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE				
Recherchies IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb H05K	ole)			
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so				
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (*)	Name der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)		
EPO-In	ternal, W <u>PI</u> Data, PAJ				
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unfer Angab	ne der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
Α	WO 02/078411 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; BUSCH, GEORG) 3. Oktober 2002 (2002-10-03) Seite 2, Zeile 9 - Seite 3, Zeile Seite 4, Zeile 12 - Seite 5, Zeile Abbildungen 1-3	e 5	1-4		
Α	US 5 758 413 A (CHONG ET AL) 2. Juni 1998 (1998-06-02) Spalte 4, Zeilen 3-54; Abbildunge	en 2-10			
Α	US 5 001 605 A (SAVAGIAN ET AL) 19. März 1991 (1991-03-19) Spalte 3, Zeile 51Spalte 4, Ze Abbildungen 2,4	eile 10;	1 ·		
Α	US 5 487 218 A (BHATT ET AL) 30. Januar 1996 (1996-01-30) Spalte 3, Zeilen 2-29; Abbildung	1	1		
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie			
* Besondere Ketagorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekledatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmekkentlicht					
"E" älleres Dokument, das ledoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "N" Veröffentlichtung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erschelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer schelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tälligkeit beruhend betrachter werden					
soil oder dis-aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden wenn die Veröffentlichung mit die Jage oder mehrene nerdenen					
*O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht eine Veröffentlichung, die verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist "P" Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist					
	Abschlusses der-Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rech	nerchenberichts		
2	8. Juli 2005	05/08/2005			
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter			
	Europaises Fateniain, P.B. 3616 Fateniaiaii 2 NL. – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 apo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Molenaar, E			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internales Aldenzeichen
PCT/EP2005/050919

im Rech <u>erchen</u> bericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 02078411	A	03-10-2002	CN WO EP	1498519 A 02078411 A1 1371275 A1	19-05-2004 03-10-2002 17-12-2003
US 5758413	A	02-06-1998	US JP JP	5699613 A 3382096 B2 9116267 A	23-12-1997 04-03-2003 02-05-1997
US 5001605	A	19-03-1991	DK ES IL JP JP	601289 A 2019743 A6 92272 A 2199897 A 7007867 B	31-05-1990 01-07-1991 12-04-1994 08-08-1990 30-01-1995
US 5487218	A	30-01-1996	EP KR US US	0713359 A1 273933 B1 RE37840 E1 5557844 A	22-05-1996 15-12-2000 17-09-2002 24-09-1996